

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 6 部門第 1 区分
【発行日】平成 25 年 2 月 21 日 (2013.2.21)

【公表番号】特表 2009-537834 (P2009-537834A)
【公表日】平成 21 年 10 月 29 日 (2009.10.29)
【年通号数】公開・登録公報 2009-043
【出願番号】特願 2009-511472 (P2009-511472)
【国際特許分類】

G 0 1 N 27/83 (2006.01)

【F I】

G 0 1 N 27/83

【誤訳訂正書】

【提出日】平成 24 年 12 月 28 日 (2012.12.28)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

励起磁場を発生させる手段を備える導電部品 (4) の非破壊検査装置 (1) において、前記発生手段が、部品の形状に合わせることでにより被検査部品の表面の一部を覆うことができるようになっているフレキシブルハウジング内に組み込まれ、

前記ハウジングが部品の部位の表面上にある時、前記励起磁場を受ける前記被検査部品から発せられる漏えい磁場の分布を測定する手段を備え、前記測定手段が前記発生手段に重ねられ、

前記測定手段が、磁場に感応する液晶膜 (7) と、前記液晶膜 (7) に重ねられた光電子マイクロセンサ網 (3) とを備えることを特徴とする装置。

【請求項 2】

前記光電子マイクロセンサが、前記部品の表面における漏えい磁場の分布のマッピングを生成することができることを特徴とする請求項 1 に記載の装置。

【請求項 3】

検出が求められる最小寸法を有する不良が存在することにより生じる漏えい磁場の部分の変化量を検出することができるよう前記光電子マイクロセンサの寸法および配置が決定されることを特徴とする請求項 2 に記載の装置。

【請求項 4】

前記励起磁場の前記発生手段がマイクロコイル網 (6) を備え、前記励起磁場を発生させるために前記マイクロコイルのそれぞれに交流電流が通ることを特徴とする請求項 1 から 3 のいずれか 1 項に記載の装置。

【請求項 5】

前記励起磁場の前記発生手段がマイクロ磁石網を備えることを特徴とする請求項 1 から 3 のいずれか 1 項に記載の装置。

【請求項 6】

各光電子マイクロセンサ (3) が、受信した光放射を電荷に変換するための感光セルを含み、前記セルが電荷を収集するための電荷移動装置に結合されることを特徴とする請求項 1 から 5 のいずれか 1 項に記載の装置。

【請求項 7】

さらに前記装置が、前記測定手段を記録メモリ (11) に接続するインタフェース電子

装置（１０）を備えることを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の装置。

【請求項８】

一体型検査装置（１）が作製されるよう前記インタフェース電子装置（１０）および前記メモリ（１１）が前記フレキシブルハウジング（２）内に組み込まれることを特徴とする請求項７に記載の装置。

【請求項９】

前記検査装置（１）がマイクロプロセッサシステムなどの演算システム（１３）を備えることを特徴とする請求項１から８のいずれか１項に記載の装置。

【請求項１０】

前記演算システム（１３）がフレキシブルハウジング（２）内に組み込まれず、前記検査装置が、記録メモリ（１１）内に記録された振動波を表す電気信号を、有線リンクまたはワイヤレスリンク、無線、赤外線を使用して、前記演算システム（１３）に送信するための送信手段を含むことを特徴とする請求項９に記載の装置。

【請求項１１】

前記演算システム（１３）が前記フレキシブルハウジング（２）内に組み込まれ、前記インタフェース電子装置（１０）と前記記録メモリ（１１）との間に接続されることを特徴とする請求項９に記載の装置。

【請求項１２】

演算システム（１３）が、単数または複数の部品の基準磁場の分布についての少なくとも１つのマップを含むメモリと、前記演算システムによって受信された電気信号を漏えい磁場の分布に変換する演算手段と、基準磁場の分布に対しマイクロセンサによって測定された磁場の前記分布を解析する手段とを備えることを特徴とする請求項９から１１のいずれか１項に記載の装置。

【請求項１３】

前記解析手段が、測定された磁場の分布と基準磁場の分布との間の比較解析手段を備えることを特徴とする請求項１２に記載の検査装置。

【請求項１４】

前記比較解析手段が、状態信号Ｓおよび部品内に存在する不良に関する情報を生成するための手段を含むことを特徴とする請求項１３に記載の装置。

【請求項１５】

検査装置（１）の前記フレキシブルハウジング（２）が接着材により被検査部品（４）の表面に固定されることを特徴とする請求項１から１４のいずれか１項に記載の検査装置

。